

## 新規・改訂スタンダード リスト

2010年3月版(0310)の新規・改訂スタンダードは以下の通りです。  
前版は、2009年11月版(1109)です。

### 製造装置ハードウェア(Hardware)

#### 新規(New Standards)

##### SEMI E154-0310

450 mm ロードポートのためのメカニカルインタフェースの仕様

#### 改訂(Technical Revisions)

##### SEMI E1-0310

プラスチックおよび金属のオープンウェーハキャリアの仕様

##### SEMI E52-0310

デジタルマスフローコントローラで使用されるガス、ガス混合物および気化して使用する材料の参照表

#### 再承認(Reapproval)

##### SEMI E15-0698E2(Reapproved 0310)

ツールロードポートの仕様

##### SEMI E131-0304(Reapproved 0310)

BOLTS-Mを使用する装置組込み測定モジュール(IMM)と300 mm ツールとの物理的インタフェースの仕様

### 製造装置ソフトウェア(Software)

#### 新規(New Standards)

##### SEMI E155-0310

MOTIONNET®用センサ/アクチュエータネットワーク(SAN)通信に関する仕様

#### 改訂(Technical Revisions)

##### SEMI E120-0310

共通装置モデル(CEM)の仕様

##### SEMI E128-0310

XML メッセージ構造に関する仕様

##### SEMI E120.1-0310

共通装置モデル(CEM)のためのXML スキーマ

##### SEMI E132-0310

装置クライアントの認証(Authentication)および権限付与(Authorization)のための仕様

##### SEMI E125-0310

装置自己記述(EqSD)の仕様

##### SEMI E132.1-0310

装置クライアントの認証および権限付与(ECA)のためのSOAP バインディングの仕様

##### SEMI E125.1-0310

装置自己記述(EqSD)のためのSOAP バインディングの仕様

#### SEMI E134-0310

データ収集管理の仕様

#### SEMI E134.1-0310

データ収集管理 (DCM) の SOAP バインディングに関する仕様

#### SEMI E139-0310

レシピとパラメータに関する管理の規定 (RaP)

#### SEMI E139.1-0310

RaP PDE のための XML スキーマ

#### SEMI E139.3-0310

レシピとパラメータ管理に関する XML/SOAP バインディング

#### SEMI E153-0310

AMHS SEM の仕様 (AMHS SEM)

### 編集上の修正 (Editorial Change)

#### SEMI E5-0709E

半導体製造装置通信スタンダード 2 メッセージ内容 (SECS-II)

## 設備 (Facility)

### 新規 (New Standards)

#### SEMI F108-0310

半導体、フラットパネルディスプレイおよび太陽電池製造用途における薬液配管の集積化に関するガイド

### 改訂 (Technical Revisions)

#### SEMI E52-0310

デジタルマスフローコントローラで使用されるガス、ガス混合物および気化して使用する材料の参照表

### 再承認 (Reapproval)

#### SEMI F19-0304 (Reapproved 0310)

ステンレススチール部品の接ガス・接液面の表面仕上げのための仕様

#### SEMI F77-0703 (Reapproved 0310)

腐食性のガスシステムに使用される合金表面の電気化学的臨界孔食温度のテスト方法

## フラットパネルディスプレイ (FPD)

### 新規 (New Standards)

#### SEMI D55-0310

色純度の評価方法のためのガイド

#### SEMI D56-0310 ※

Measurement Method for Ambient Contrast of Liquid Crystal Displays

#### SEMI D57-0310 ※

Definition of Measurement Index (VCT) for Mura in FPD Image Quality Inspection

#### SEMI D58-0310 ※

Terminology and Test Pattern for the Color Breakup of Field Sequential Color Display

## ガス (Gases)

ガス分野について、本出版サイクルでは新規改訂の規格はありません。

## 材料 (Materials)

### 改訂 (Technical Revision)

#### SEMI M50-0310

オーバーレイ法による走査型表面検査システム  
用捕獲率および偽計数率を決定するための  
試験方法

#### SEMI M53-0310

パターンのない半導体ウェーハ表面上に証明  
済み手法で付着した単分散標準粒子を用いた  
走査型表面検査システム校正の作業方法

#### SEMI M59-0310

シリコン技術の用語集

#### SEMI M71-0310

CMOS LSI 用シリコン・オン・インシュレーター  
(SOI)ウェーハのための仕様

## MEMS

### 改訂 (Technical Revision)

#### SEMI MS5-0310 ※

Test Method for Wafer Bond Strength  
Measurements Using Micro-Chevron Test  
Structures

## マイクロソグラフィ (Microlithography)

マイクロソグラフィ分野について、本出版サイクルでは新規改訂の規格はありません。

## パッケージング (Packaging)

パッケージング分野について、本出版サイクルでは新規改訂の規格はありません。

## 太陽光発電 (Photovoltaic)

### 新規 (New Standards)

#### SEMI PV3-0310

太陽電池加工に用いる高純度水に関するガイド

### 編集上の修正 (Editorial Change)

#### SEMI PV2-0709E

PV 製造装置通信インタフェース (PVECI)

## プロセスケミカル (Process Chemicals)

### 改訂 (Technical Revision)

#### SEMI CI-0310

液体化学薬品の分析のためのガイド

## 安全 (Safety)

### 新規 (New Standards)

#### SEMI S27-0310

環境、健康、安全 (ESH) 評価報告書の内容に関する安全ガイドライン

### 改訂 (Technical Revision)

#### SEMI S2-0310

半導体製造装置の環境、健康、安全に関するガイドライン

#### SEMI S5-0310

流量制限デバイスの安全ガイドライン

#### SEMI S7-0310

評価要員および評価会社の資質に関する安全ガイドライン

#### SEMI S22-0709a

半導体製造装置の電気設計のための安全に関するガイドライン

## シリコンマテリアル&テスト方法 (Silicon Materials & Process Control)

### 改訂 (Technical Revision)

#### SEMI MF391-0310 ※

Test Methods for Minority Carrier Diffusion Length in Extrinsic Semiconductors by Measurement of Steadystate Surface Photovoltage

#### SEMI MF1811-0310 ※

Guide for Estimating the Power Spectral Density Function and Related Finish Parameters from Surface Profile Data

#### SEMI MF533-0310 ※

Test Methods for Thickness and Thickness Variation of Silicon Wafers

## トレーサビリティ (Traceability)

### 改訂 (Technical Revision)

#### SEMI T16-0310 ※

Specification for Use of Data Matrix Symbology for Automated Identification of Extreme Ultraviolet Lithography Masks

※印の付いた規格は、本出版サイクルで日本語翻訳版を出版しておりませんので、ご了承ください。

(オンデマンドライブラリにてご提供しているのは、当リスト掲載の新規改訂の規格のうち、日本語翻訳版のあるもののみです。)

以上